

Messgrenzen verschoben

Mit dem Dickenmesssystem «thicknessControl UTS 8X02.K» bringt Micro-Epsilon eine Lösung für die Kontrolle von transparenten und semitransparenten Bandmaterialien, die mit Laser-basierten Systemen nur schwer oder gar nicht zu realisieren ist.

(pi) Mit dem Messgerät «thicknessControl UTS 8X02.K» bietet die Micro-Epsilon Messtechnik GmbH erstmals ein C-rahmenförmiges Dickenmesssystem auf konfokaler Basis. Das System verspricht speziell auf transparenten und semitransparenten Materialien wie Kunststoffplatten, die nicht mehr über eine Walze geführt werden können, beschichtetem Glas oder Metall sowie hochglänzend poliertem Metall hochgenaue Messungen. Bisherige Dickenmesssysteme auf Basis von Laserpunkt-, Laserlinien- oder Wirbelstromsensoren stossen hier laut Micro-Epsilon an ihre Grenzen.

Die Belichtungszeitregelung der integrierten konfokalen Sensoren ermöglicht die zuverlässige Messung auf wechselnden Oberflächen. Die konfokalen Senso-

ren mit Multipeak-Option sollen zudem Messungen von Objekten zulassen, die aus mehreren transparenten Schichten bestehen. Die Messungen erfolgen berührungslos und rückwirkungsfrei mit Hilfe des konfokal-chromatischen Messprinzips, sodass auch empfindliche Materialien sicher vermessen werden können. Die Justierung des Systems mittels opto-elektronischem Werkzeug erfolgt vor Auslieferung. Eine Nachjustierung ist über das integrierte Kalibriertarget möglich.

Die Messanlage verfügt über ein umfangreiches Softwarepaket zur Analyse, Darstellung und Archivierung der überwachten Produktionsdaten. Zudem lassen sich verschiedene Messmodi einstellen wie Festspurdickenmessung an beliebigen Positionen, Messung



Besonders bei transparenten oder durchscheinenden Kunststoffen soll das «thicknessControl UTS 8X02.K-System» seine Stärken ausspielen können. (Bild: Micro-Epsilon)

des Dickenprofils oder mehrerer Längstrends. ■

Micro-Epsilon (Swiss) AG

9300 Wittenbach, Tel. 071 250 08 38
info@micro-epsilon.ch